(19) BUNDESREPUBLIK (10) Off nlegungsschrift **DEUTSCHLAND**

₍₁₎ DE 3324232 A1



DEUTSCHES PATENTAMT Aktenzeichen: P 33 24 232.1 Anmeld tag: 5. 7.83 Offenlegungstag: 17. 1.85

(5) Int. Cl. 3:

C01 B 33/02

B 01 J 21/06 B 01 J 35/04 C 25 F 3/12 H 01 L 21/306 H 01 L 31/18 C 30 B 33/00

(71) Anmelder:

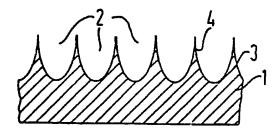
Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

(72) Erfinder:

Föll, Helmut, Dr.rer.nat., 8000 München, DE; Grabmaier, Josef, Dr.rer.nat., 8137 Berg, DE; Lehmann, Volker, 5100 Aachen, DE

(A) Verfahren zum Herstellen von aus kristallinem Silizium bestehenden Körpern mit einer die Oberfläche vergrößernden Struktur, sowie deren Anwendung als Substrate für Solarzellen und Katalysatoren

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Siliziumkörpem (1, 2, 3), bei denen mindestens eine ihrer Oberflächen mit einer die Oberfläche vergrößernden wabenzellenartigen Struktur (2, 3) versehen ist, sowie Anwendungen dieser Körper. Dabei wird die wabenzellenartige Struktur (2, 3) durch Ätzen, insbesondere durch elektrolytische Ätzung in einem flußsäurehaltigen Elektrolyten in die Oberfläche (4) eingebracht, wobei der Siliziumkörper (1) als positiv gepolte Elektrode geschaltet wird. Das Verfahren dient zur Herstellung von Substraten für Siliziumsolarzellen, deren Frontseite durch die wabenzellenartige Struktur eine Licht total absorbierende Oberfläche aufweist. Es kann auch für die Herstellung von Substraten für die Beschichtung von Katalysatoren verwendet werden.



- × - VPA 83 P 1 4 6 3 DE

<u>Patentansprüche</u>

 Verfahren zum Herstellen eines aus kristallinem Silizium bestehenden Körpers, der an mindestens einer seiner Oberflächenseite mit einer die Oberfläche vergrößernden Struktur versehen ist, dad urch gekennzeichnet, daß die Struktur in Form von in die Oberfläche (1, 4) eingeätzten Wabenzellen (2, 3) erzeugt wird.

10

Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t , daß die wabenzellenförmige Struktur (2, 3) durch elektrolytische Ätzung in einem Flußsäureelektrolyten (5, 6) erzeugt wird, wobei der aus Silizium bestehende Körper (1) als positiv gepolte Elektrode eine Elektrolysierzelle (5, 6) geschaltet wird, und die Gegenelektrode (7) aus einem gegenüber Flußsäure resistenten Material, vorzugsweise aus Graphit, besteht.

20

- 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß dem Elektrolyten (6) ein Netzmittel zugesetzt wird.
- 25 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Netzmittel Alkohol und/oder saure Netzmittel auf Formaldehydbasis verwendet werden.
- 30 5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeich net, daß eine Stromdichte im Bereich von 5 30 mA/cm² und eine Spannung im Bereich von 2 10 V eingestellt wird.

83 P 1463 DE

- 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrolyse durch Einstrahlung von Licht iniziert wird.
- 7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Flußsäurekonzentration (6) auf ungefähr 2,5 % und die Ätzzeit auf 10 - 20 Minuten eingestellt wird.
- 10 8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß im Anschluß an die Ätzung ein Tauchprozeß in 20%iger Kalilauge durchgeführt wird.
- 9. Anwendung des Verfahrens nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8 zur Herstellung von Siliziumsubstraten (1, 2, 3) mit einer Frontseite für den Lichteinfall mit wabenzellenförmiger, Licht total absorbierender Oberfläche für Solarzellen, wobei die Weite und Tiefe der
 Wabenzellen (2) im Bereich von 10 20 μm und die Wabenzellenwände (3) kleiner 10 μm sind.
- 10. Anwendung des Verfahrens nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Herstellung von Siliziumkörpern 25 mit durch wabenzellenartige Vertiefungen vergrößerten Oberflächen, die als Substrate zur Beschichtung von Katalysatormaterialien verwendet werden.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München

15

Unser Zeichen
VPA
83 P 1463 NF

- Verfahren zum Herstellen von aus kristallinem Silizium bestehenden Körpern mit einer die Oberfläche vergrößernden Struktur, sowie deren Anwendung als Substrate für Solarzellen und Katalysatoren
- 10 Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines aus kristallinem Silizium bestehenden Körpers, der an mindestens einer seiner Oberflächenseiten mit einer die Oberfläche vergrößernden Struktur versehen ist, sowie seine Anwendung.
- Siliziumkörper mit mindestens einer die Oberfläche vergrößernden Struktur werden benötigt bei der Herstellung
 von Solarzellen. Diese Solarzellen sollen das einfallende Licht, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erreichen, unabhängig von der Wellenlänge vollständig absorbieren, d.h., es sollte keine Reflexion auftreten.
 Unstrukturierte Siliziumoberflächen erfüllen diese Bedingung nicht.
- Es ist bekannt, zur Unterdrückung der Reflexion auf die Frontseite der Solarzelle eine Antireflexschicht aus transparenten dielektrischen Stoffen, wie SiO₂ oder Titandioxid aufzudampfen. Diese Schichten vermindern zwar die Lichtreflexion, doch gilt dies nicht für alle Wellenlängen und Einfallsrichtungen. Beim Sonnenlicht soll ein möglichst breites Spektrum zur Solarenergie-erzeugung ausgenutzt werden. Das auffallende Licht soll unabhängig von der Wellenlänge durch Vielfachreflexion eingefangen werden. Ein weiterer Nachteil der licht-optischen Antireflexionsbeläge neben der Wellenlängen-Edt 1 Sti/28.6.83

83 P 1463 DE - 2 -VPA.

abhängigkeit ist der hohe Kostenaufwand.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur Herstellung eines Siliziumkörpers anzugeben, welches die 5 als Frontseite für Solarzellen verwendete Oberfläche mit einer die Oberfläche vergrößernden Struktur versieht. Diese Struktur soll so beschaffen sein, daß das einfallende Licht unabhängig von der Wellenlänge vollständig absorbiert wird und mit einem hohen Wirkungsgrad zur Solarenergienutzung ausgewertet werden kann.

In dieser Richtung sind schon viele Versuche unternommen worden. So ist beispielsweise aus der DE-OS 30 47 383 eine Solarzelle mit erhöhtem Wirkungsgrad bekannt, deren Oberfläche eine Rippenstruktur hat und bei der die Zwischenräume zwischen jeweils benachbarten Rippen mit einem für die Solarstrahlung gut durchlässigem Material ausgefüllt sind, wobei sich in diesem Material die Strahlung stark streuende Partikel befinden.

20

10

15

Des weiteren ist aus der DE-OS 28 28 744 eine Anordnung zum Absorbieren von Sonnenenergie bekannt, die aus einem amorphen Halbleiterkörper mit einer geätzten Fläche besteht, die eine Reihe von nadelförmigen Gebilden aufweist, deren Achsen in Richtung des Energieeinfalls ausgerichtet sind. Die nadelförmige Oberfläche wird im Falle von Silizium als Halbleitermaterial durch Ätzen in einer Mischung aus Flußsäure, Salpetersäure und Wasser (10:1:1) erhalten.

30

25

Die Erfindung beschreitet einen anderen Weg zur Lösung der Aufgabe der Herstellung einer strukturierten Oberfläche eines Siliziumkörpers mit maximaler Lichtabsorption und ist durch ein Verfahren der eingangs ge-35 nannten Art dadurch gekennzeichnet, daß die Struktur in Form von in die Oberfläche eingeätzten Waben erzeugt

- X - VPA 83 P 1463 NF

wird. Dabei liegt es im Rahmen der Erfindung, daß die wabenzellenförmige Struktur durch elektrolytische Ätzung in einem Flußsäureelektrolyten erzeugt wird, wobei der aus Silizium bestehende Körper als positiv gepolte Elektrode einer Elektrolysierzelle geschaltet wird und die Gegenelektrode aus einem gegenüber Flußsäure resistenten Material, vorzugsweise aus Graphit, besteht.

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, dem Elektrolyten
10 ein Netzmittel zur Verbesserung der Benetzung des Siliziumkörpers zuzusetzen, wobei insbesondere Alkohol oder
saure Netzmittel auf Formaldehydbasis (z.B. Mirasol der
Fa. Tetenal) verwendet werden. Um die benötigte Stromdichte bei der Elektrolyse zu erreichen, wird der Sili15 ziumkörper mit Licht geeigneter Intensität
(50 - 500 mW/cm² entsprechend ungefähr 10⁴ bis 10⁵ lux)
beleuchtet.

Weitere Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er20 findung gehen aus den Unteransprüchen sowie nachfolgend aus der anhand der Figuren 1 und 2 gegebenen
Beschreibung hervor. Dabei zeigt die Figur 1 eine
Schnittdarstellung eines nach der Erfindung hergestellten Siliziumkörpers und die Figur 2 schematisch
25 den Ätzprozeß einer Elektrolysierzelle.

Figur 1: Mit dem Bezugszeichen 1 ist eine aus polykristallinem Silizium bestehende, n-dotierte Scheibe bezeichnet, die durch elektrolytische Ätzung an ihrer Oberfläche 4 (wie in Figur 2 beschrieben) mit einer wabenzellenartigen Struktur (siehe Pfeile 2) versehen ist. Die Weite und Tiefe der Wabenzellen 2 beträgt dabei 10 - 20 μm; die Wände 3 sind dagegen nur 2 - 5 μm dick. Innerhalb dieser Wabenzellen 2 erfolgt bei Lichteinfall eine Vielfachreflexion und dadurch

VPA 83 P 1463 DE

Totalabsorption von Licht aller Wellenlängen; die Oberfläche erscheint dadurch tief-schwarz. Es wurde festgestellt, daß ein solcher Siliziumkörper mit der wabenartigen Oberfläche im Vergleich zu einem nicht geätzten Siliziumkörper bei Beleuchtung einen bis zu 30% höheren Fotostrom erzeugt. Damit ist ein höherer Solarzellenwirkungsgrad zu erreichen als bei Solarzellen mit normaler Oberfläche.

10 Figur 2: Die in Figur 1 gezeigte wabenzellenförmige Oberflächenstruktur entsteht durch definierte elektrolytische Auflösung. Dazu wird in einem, in einem Behälter 5 befindlichen wäßrigen Flußsäureelektrolyten 6 der n-dotierte Siliziumkörper 1 als positiv gepolte Elek-15 trode der Elektrolysierzelle geschaltet. Die Gegenelektrode 7 kann aus beliebigem, gegenüber Flußsäure resistentem Material, z.B. aus Platin oder vorzugsweise aus Graphit, bestehen. Die wabenzellenartige Oberflächenstruktur 2 entsteht bei Stromdichten zwischen un-20 gefähr 5 - 30 mA/cm² und Spannungen von 2 - 10 V. Die Spannungsquelle ist mit 8, die Zuführungen mit 9 bezeichnet. Um die benötigte Stromdichte zu erreichen, wird der Siliziumkörper 1 mit Licht geeigneter Intensität beleuchtet (in der Figur nicht dargestellt). Unter 25 diesen Bedingungen erfolgt anodische Auflösung an den nicht mit einer Schutzschicht bedeckten Oberflächen des Siliziumkörpers 1 in solcher Weise, daß die gewünschte Wabenzellenstruktur 2 erzeugt wird. Die zur Erzielung ausreichend tiefer Waben notwendige Ätzzeit hängt von 30 der Flußsäurekonzentration ab und beträgt bei einer Flußsäurekonzentration von ungefähr 2,5 % etwa 10 - 20 Minuten. Durch geeignete Wahl der Parameter: Spannung, Stromdichte und Flußsäurekonzentration läßt sich die Ätzdauer auch kürzer halten. Eine gelegentlich 35 der wabenartigen Oberfläche sich überlagernde gelbliche

VPA 83 P 1463 DF

Schicht läßt sich durch kurzzeitiges Eintauchen des Körpers 1, 2 in 20%ige Kalilauge leicht entfernen. Vor der Ätzbehandlung hell reflektierend erscheinende Siliziumoberflächen sind nach der Behandlung dunkel bis tief-schwarz.

Zur Herstellung von Solarzellen werden in die mit der wabenzellenartigen Struktur versehene Oberfläche (Frontseite der Zelle) Dotierstoffatome vom p-Leitungstyp durch Diffusion oder Ionenimplantation eingebracht und ein pn-Übergang erzeugt. Die Kontaktierung erfolgt in bekannter Weise, z.B. durch Elektrolyt-Kontakte oder Schottky-Kontakte, um den Ohm'schen Widerstand der Strom sammelnden Schichten gering zu halten.

15

5

Andere Anwendungsmöglichkeiten für das Verfahren nach der Lehre der Erfindung liegen auf dem Gebiet der Katalyse, wo Substrate aus Silizium mit großem Oberflächen/ Volumen-Verhältnis vorteilhaft sind. Das Katalysatormaterial wird dazu auf die wabenzellenartige Oberfläche 20 aufgebracht. Bei Verwendung sehr dünner (ungefähr 20 - 50 μm dicker) Siliziumkristallscheiben können die Wabenzellenkanäle auch die ganze Kristallscheibe durchdringen. Dies ermöglicht die Herstellung von sehr effek-25. tiven Durchlauf-Katalysatoren.

2 Figuren 10 Patentansprüche

30

Nummer:

Nummer: 33 24 232
Int. Cl.³: C 01 B 33/02
Anmeldetag: 5. Juli 1983
Offenlegungstag: 17. Januar 1985
83 P 1 4 6 3 DE

-g.

FIG 1

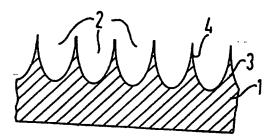


FIG 2

